

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公開番号】特開 2001-210693 (P2001-210693A)
【公開日】平成 13 年 8 月 3 日 (2001.8.3)
【出願番号】特願 2000-17223 (P2000-17223)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/68

G 0 2 F 1/13

【F I】

H 0 1 L 21/68 A

G 0 2 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 5 月 7 日 (2004.5.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項 1 の液晶表示装置の製造装置は、基板を洗浄する洗浄処理室と、洗浄処理室で洗浄された基板に対して成膜処理を行う成膜処理室と、洗浄処理室から成膜処理室へ基板を外気にさらすことなく移送する外気遮断移送手段とを備える。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

請求項 2 の液晶表示装置の製造装置では、請求項 1 の装置において、外気遮断移送手段が、洗浄処理室から成膜処理室まで基板が移送される通路であって外気が遮断された外気遮断通路と、該外気遮断通路内において基板を搬送する搬送機とを備えている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

請求項 3 の液晶表示装置の製造装置では、請求項 1 の装置において、外気遮断移送手段は、洗浄処理室で洗浄された基板を外気にさらすことなく、外気と隔離可能な密閉力セット内に搬入する基板搬入手段と、成膜処理室において基板を密閉力セット内から取り出す基板取出し手段とを備えている。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 3 】

請求項 4 の 液晶表示装置の製造装置では、請求項 1 または 2 の装置において、カセットロード室と、搬送ロボットを有する搬送ロボット室（ロードロック室）とをさらに備え、カセットロード室、洗浄処理室および成膜処理室は、いずれも、搬送ロボットの周囲に配置され、搬送ロボットによって基板の出し入れができるように搬送ロボット室と連絡している。